

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年3月13日(2014.3.13)

【公開番号】特開2014-17499(P2014-17499A)

【公開日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【年通号数】公開・登録公報2014-005

【出願番号】特願2013-173501(P2013-173501)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

H 01 L 21/677 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

G 02 F 1/13 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 4 F

H 01 L 21/304 6 4 4 E

H 01 L 21/304 6 4 8 A

H 01 L 21/68 A

H 01 L 21/30 5 7 2 B

G 02 F 1/13 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成25年12月24日(2013.12.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を洗浄処理する基板洗浄装置において、

基板に洗浄液を供給する洗浄液供給手段と、

基板に洗浄部材を当接させて洗浄する洗浄手段と、

前記基板の洗浄中、基板を保持する第1の基板保持手段と、

前記第1の基板保持手段により基板を保持する位置よりも下方側の退避位置と、当該第1の基板保持手段との間で基板の受け渡しを行う前記退避位置よりも上方側の受け渡し位置との間で昇降を行う昇降機構を備えた第2の基板保持手段と、

前記第2の基板保持手段への洗浄液の滴下を防止するため、前記退避位置に退避した第2の基板保持手段の上面を覆うカバー部材と、を備えたことを特徴とする基板洗浄装置。

【請求項2】

前記カバー部材は、前記第2の基板保持手段の側方へ退避した位置と、当該第2の基板保持手段の上面を覆う位置との間を横方向に移動させる支持部に支持されていることを特徴とする請求項1に記載の基板洗浄装置。

【請求項3】

前記カバー部材の上面には、当該カバー部材の中央側から周縁側へ向けて低くなる傾斜面が形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の基板洗浄装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

**【補正の内容】****【0010】**

本発明に係る基板洗浄装置は、基板を洗浄処理する基板洗浄装置において、  
基板に洗浄液を供給する洗浄液供給手段と、  
基板に洗浄部材を当接させて洗浄する洗浄手段と、  
前記基板の洗浄中、基板を保持する第1の基板保持手段と、  
前記第1の基板保持手段により基板を保持する位置よりも下方側の退避位置と、当該第1の基板保持手段との間で基板の受け渡しを行う前記退避位置よりも上方側の受け渡し位置との間で昇降を行う昇降機構を備えた第2の基板保持手段と、  
前記第2の基板保持手段への洗浄液の滴下を防止するため、前記退避位置に退避した第2の基板保持手段の上面を覆うカバー部材と、を備えたことを特徴とする。

**【手続補正3】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0011****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0011】**

前記基板洗浄装置は、以下の構成を備えていてもよい。  
(a) 前記カバー部材は、前記第2の基板保持手段の側方へ退避した位置と、当該第2の基板保持手段の上面を覆う位置との間を横方向に移動させる支持部に支持されていること  
。

(b) 前記カバー部材の上面には、当該カバー部材の中央側から周縁側へ向けて低くなる傾斜面が形成されていること。

**【手続補正4】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0012****【補正方法】削除****【補正の内容】****【手続補正5】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0013****【補正方法】削除****【補正の内容】****【手続補正6】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0014****【補正方法】削除****【補正の内容】****【手続補正7】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0015****【補正方法】削除****【補正の内容】****【手続補正8】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0016****【補正方法】削除****【補正の内容】****【手続補正9】****【補正対象書類名】明細書**

【補正対象項目名】0017

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

本発明に係る基板洗浄装置によれば、第1の基板保持手段が基板を保持する位置よりも下方側に退避した第2の基板保持手段の上面をカバー部材により覆うので、当該第2の基板保持手段の上面への洗浄液の滴下を防止し、清浄な状態に維持することができる。